

Single Element Series

システム構成例1 XSDD50-01GRCH-SYS

シリコンドリフト検出器

XSDD50-01GRCH

1台



筒長：標準200mm
※カスタマイズ可



XAFS計測用デジタルスペクトロメータ
APU101X
1台

システム構成例2 XSDD50-01GRCL-ICF-SYS

真空対応シリコンドリフト検出器

XSDD50-01GRCL-ICF

1台



筒長：標準200mm
※カスタマイズ可
フランジ：ICF70



XAFS計測用デジタルスペクトロメータ
APU101X
1台

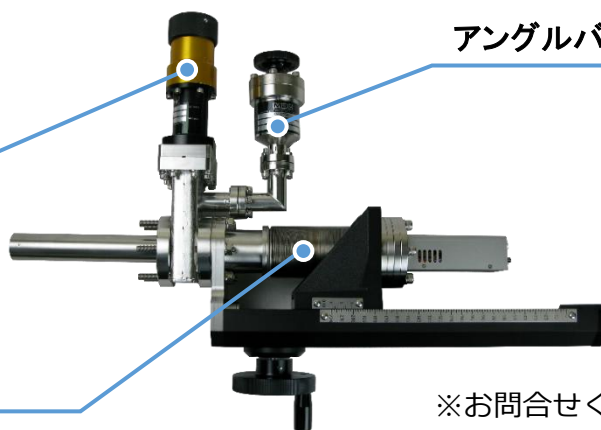
オプション

- ・真空対応ベローズ付駆動機構
- ・ゲートバルブ
- ・アングルバルブ など

ゲートバルブ

アングルバルブ

真空対応ベローズ付駆動機構



※お問合せください



Single Element Series

システム構成例 XSDD50-01GRCH-SYS



窓材一覧

種類	型式表記	厚み	備考
窓無	WL	-	He およびN雰囲気可。
グラフェン	GRCH	1 μm	高エネルギー向け。 8 μm および12.5 μm Be窓の互換。サポートグリッドなし。
	GRCL	165 nm	低エネルギー向け。 シリコンサポートグリッド(開口率86%)
シリコン ナイトライド	C1	150 nm	遮光性あり。
	C2	40 nm	遮光性なし。He雰囲気不可。
ベリリウム	Be	12.5 μm	

1素子シリコンドリフト検出器シリーズ

窓材	環境		遮光	有効面積/コリメート面積	型式
	大気	真空			
WL	×	○	要	41 mm ² /28 mm ²	XSDD30-01WL-ICF
				65 mm ² /47 mm ²	XSDD50-01WL-ICF
GRCH	○	○	-	41 mm ² /28 mm ²	XSDD30-01GRCH(-ICF)
				65 mm ² /47 mm ²	XSDD50-01GRCH(-ICF)
GRCL	○	○	要	41 mm ² /28 mm ²	XSDD30-01GRCL(-ICF)
				65 mm ² /47 mm ²	XSDD50-01GRCL(-ICF)
C1	○	○	-	70 mm ² /50 mm ²	XSDD50-01C1(-ICF)
C2	○	○	要	70 mm ² /50 mm ²	XSDD50-01C2(-ICF)
Be	○	○	-	70 mm ² /40 mm ²	XSDD1T50-01Be(-ICF)

